

MEMS 工艺线专用去离子水设备

MEMS 工艺线去离子水

虽然大部分人对于 MEMS (Microelectromechanical systems, 微机电系统/微机械/微系统) 还是感到很陌生, 但是其实 MEMS 在我们生产, 甚至生活中早已无处不在了, 智能手机, 健身手环、打印机、汽车、无人机以及 VR/AR 头戴式设备, 部分早期和几乎所有近期电子产品都应用了 MEMS 器件。

MEMS 是一门综合学科, 学科交叉现象及其明显, 主要涉及微加工技术, 机械学/固体声波理论, 热流理论, 电子学, 生物学等等。MEMS 器件的特征长度从 1 毫米到 1 微米, 相比之下头发的直径大约是 50 微米。

MEMS 工艺线去离子水

MEMS 传感器主要优点是体积小、重量轻、功耗低、可靠性高、灵敏度高、易于集成等, 是微型传感器的主力军, 正在逐渐取代传统机械传感器, 在各个领域几乎都有研究, 不论是消费电子产品、汽车工业、甚至航空航天、机械、化工及医药等各领域。

常见产品有压力传感器, 加速度计, 陀螺, 静电致动光投影显示器, DNA 扩增微系统, 催化传感器。

MEMS 的快速发展是基于 MEMS 之前已经相当成熟的微电子技术、集成电路技术及其加工工艺。MEMS 往往会采用常见的机械零件和工具所对应微观模拟元件, 例如它们可能包含通道、孔、悬臂、膜、腔以及其它结构。然而, MEMS 器件加工技术并非机械式。相反, 它们采用类似于集成电路批处理式的微制造技术。

MEMS 工艺线去离子水

批量制造能显著降低大规模生产的成本。若单个 MEMS 传感器芯片面积为 5 mm x 5 mm, 则一个 8 英寸(直径 20 厘米)硅片(wafer)可切割出约 1000 个 MEMS 传感器芯片(图 1), 分摊到每个芯片的成本则可大幅度降低。

因此 MEMS 商业化的工程除了提高产品本身性能、可靠性外, 还有很多工作集中于扩大加工硅片半径(切割出更多芯片), 减少工艺步骤总数, 以及尽可能地缩传感器大小。

MEMS 工艺线去离子水

仟净公司, MEMS 制造工艺用去离子水设备资料如下:

MEMS 工艺线去离子水设备功能

- 1、直接将自来水或地下水制备出符合标准的 MEMS 制造工艺用去离子水;
- 2、缺水保护;
- 3、水满停机;
- 4、前置过滤器自清洗;
- 5、水质在线监测功能;
- 6、开停机时系统自动清洗延长机器使用寿命;



MEMS 工艺用 DI 水设备特点:

1. 安装简单, 使用方便, 一键操作;
2. 水质不合格报警功能;
3. 一体化设计, 占地面积省。
4. EDI 电去离子工艺, 使用耗材成本低。

序号	型 号	额定产水量	出水标准	功率	电源
1	Q-200EA- II	200L/H	MEMS 工艺线用 离子水标准	1800W	220V/AC
2	Q-300EA- II	300L/H		2000W	220V/AC
3	Q-500EA- II	500L/H		2300W	380V/AC

第三项, 380V 的可订制 220V, 成本不变。

【双项专利-性价比之王】

仟净纯水设备, 通过双项专利, 并获得多项荣誉。



专利-漏水智能切断水源

是否因为漏水让车间水漫金山, 仟净专利
智能漏水保护功能让您更省心

IF WE KNOW FOR LEAKS WATER ANYWHERE, THE LEAKAGE IS NOT
TILL YOU KNOW NOW INTELLIGENT LEAKAGE PROTECTION FUNCTION

专利-水质不合格报警或停机

杜绝因为水质不合格影响产品质量

IF WE KNOW THE QUALITY OF WATER IS
BADLY IMPACT PRODUCT QUALITY

2005-2018 东莞市仟净环保设备有限公司 版权所有, 并保留所有权利

东莞万江区大汾工业区, 邮编: 523000 0769-26380198 /13559753668 www.qjhb.net

仟净环保 欢迎免费下载